

技術講習会のご案内

【分光エリプソメーター】

当研究所では、公益財団法人 JKA の平成 29 年度公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業により「分光エリプソメーター」を導入しました。分光エリプソメーターは、材料の屈折率や消衰係数、薄膜の膜厚を非破壊で精度良く測定することができる装置です。この度、その特徴をより具体的にご理解いただき、ご利用の一助となることを目的として、本装置の初心者向け技術講習会を下記の要領で開催いたしますので、ご案内申し上げます。

◆日 時：平成 30 年 5 月 8 日 (火) ① 9:45~11:45 ② 13:15~15:15
平成 30 年 5 月 18 日 (金) ③ 9:45~11:45 ④ 13:15~15:15

※①~④とも同じ内容の講習を行います。ご希望の時間帯をお選び下さい。

(バスでお越しの場合、①、③は 9:27 ②、④は、12:54 に和泉中央駅を出発するバスで間に合います。)

○当研究所内に食堂がございます。一般の方もご利用になれます。(営業時間：11:45~13:15)

◆場 所：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター (和泉市あゆみ野2-7-1)

当日は、講習開始時刻までに当研究所の玄関ホール 講習会受付にて、受付をお済ませください。担当者が講習会場にご案内します。(受付は講習会開始時間の 10 分前より始めます。)

◆定 員：各コース(①~④)とも 1 社のみ。参加人数は、1 社 3 名まで。

※ 受講票は発行いたしません。返信で受付をお知らせします。

◆費 用：無料

◆申込み先：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 顧客サービス部

※ お申込みは、メール (fukyu@tri-osaka.jp) または FAX (0725-51-2520) でお願います。

◆対象機器：分光エリプソメーター (M-2000UI)

H29年度JKA機械設備拡充補助事業により導入しました分光エリプソメーター(M-2000UI)を用いた初心者向けの講習を開催します。本講習では、エリプソメーターの原理を説明した後、機器の概要説明を行います。その後、実習用試料の屈折率や膜厚等を測定することにより、装置の操作方法を説明します。なお、本講習会では、受講者による持ち込み試料の対応はいたしません。

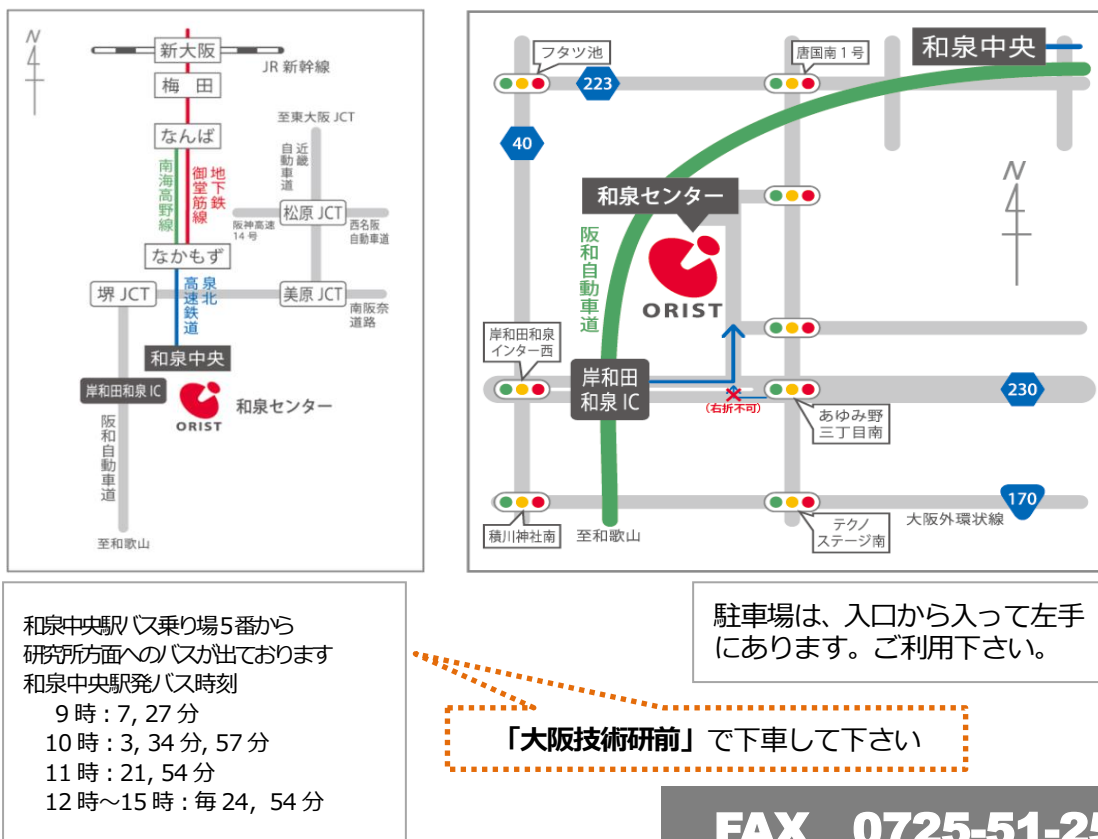


機器型番：M-2000UI
ジェー・エー・ウーラム・ジャパン株式会社

◆講習担当：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター
電子・機械システム研究部 佐藤和郎

・お問い合わせ先：顧客サービス部 TEL：0725-51-2518

大阪産業技術研究所 和泉センター 交通案内図 (略図)



技術講習会 申込書 テーマ「分光エリプソメーター」

開催日：H30年5月8日(火)、5月18日(金)

会社名			
所在地	(〒 -)		
参加者	所属：	役職：	氏名： (K)
	所属：	役職：	氏名： (K)
	所属：	役職：	氏名： (K)
利用者カードをお持ちの方は、「K番号」のご記入もお願いします。			
連絡先	TEL：	FAX：	
希望コース (第1希望～第2希望までのコース番号をご記入ください)	第1希望：	第2希望：	
	①	平成30年5月8日(火) 9:45～11:45	
	②	平成30年5月8日(火) 13:15～15:15	
	③	平成30年5月18日(金) 9:45～11:45	
	④	平成30年5月18日(金) 13:15～15:15	
講習会の情報源	①Webページ ②メール配信 ③チラシ ④他機関の情報 ⑤その他 ()		

※上記参加申込書に記載された内容につきましては、本講習会の参加者の集計及び下記の目的に使用させていただきます。

- ①お客様からの問い合わせへの対応、当研究所利用に関する手続きの案内など、お客様サポート。
- ②当研究所および関連団体の催事情報提供などの案内。

※ 講習会の申込状況の確認はこちら →<http://orist.jp/izumi/events/seminar/>

※ 講習会の案内など、当研究所の関連情報をお知らせする「ORIST EXPRESS 和泉センター版」の配信を新規にご希望の方はこちら →http://orist.jp/mail_magazine/magazine_izumi.html